

レーザー協会 第 184 回研究会

「高出力レーザーとその応用技術」

【日時】 2019 年 5 月 22 日(水) 14:30~17:00**【会場】** 中央大学 後楽園キャンパス

6 号館 3 階 6326 号室

〒112-8551 東京都文京区春日 1-13-27

<https://www.chuo-u.ac.jp/access/kourakuen/><https://www.chuo-u.ac.jp/campusmap/kourakuen/>14:30~14:35 **開会挨拶**

レーザー協会会長

14:35~15:15 **講演 1** 「10 kW 出力高輝度ファイバレーザーの性能と加工特性」

古河電気工業株式会社 西潟 由博 氏

15:15~15:55 **講演 2** 「高出力固体レーザー溶接におけるスパッタ抑制技術の開発」

三菱電機株式会社 久場 一樹 氏

15:55~16:15 **休憩**16:15~16:55 **講演 3** 「レーザークリーニングの最新技術動向とその応用事例」

クリーンレーザー・ジャパン株式会社 本村 孔作 氏

16:55~17:00 **閉会挨拶****【参加費】** 会員:無料, 非会員:4,000 円 (当日お支払いください)**【申し込み先】** 会員の方は別途お送りする案内にある返信票に記入のうえレーザー協会事務局へメールでご送付ください。非会員の方はレーザー協会ウェブページ <http://jslt.jp/> の申し込みフォームよりお申し込みください。**【問合せ先】** レーザー協会事務局 laser@mech.saitama-u.ac.jp